

Квадратный Резервуар Из Птфэ Для Полупроводников, Вымачивания, Очистки, Устойчивый К Кислотам, Фильтрационный Сосуд Из Фторполимера

Артикул: PL-CP53



введение

Максимизируйте эффективность в производстве полупроводников с помощью наших квадратных резервуаров из ПТФЭ, разработанных для превосходной устойчивости к кислотам и чистоты при следовом анализе. Эти высокопроизводительные сосуды из фторполимера обеспечивают вымачивание без загрязнений и надежную работу с химикатами для самых требовательных современных лабораторных и промышленных процессов.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Травление полупроводниковых пластин	Погружение кремниевых пластин в ванны с концентрированной кислотой для модификации поверхности и удаления загрязнений.	Предотвращает загрязнение металлическими ионами и устойчиво к агрессивным смесям HF/HNO ₃ .
Обработка солнечных элементов	Текстурирование и очистка кремниевых подложек в крупномасштабных линиях фотоэлектрического производства.	Долговечность при больших объемах и устойчивость к щелочным растворам для травления.
Подготовка проб для следового анализа	Кислотное разложение и вымачивание лабораторной посуды для обеспечения нулевого уровня загрязнения.	Ультранизкий профиль вымывания, необходимый для пределов обнаружения на уровне PPT.
Восстановление драгоценных металлов	Использование в качестве реакционного сосуда или сосуда для вымачивания при растворении металлов в царской водке или цианидных растворах.	Полная невосприимчивость к окислительному воздействию и стабильность при высоких температурах.
Очистка аэрокосмических компонентов	Обезжиривание и удаление накипи высокоточных компонентов двигателя с использованием агрессивных химических агентов.	Долгосрочная надежность в суровых промышленных условиях с тяжелыми циклами работы.
Синтез фармацевтических препаратов	Использование в качестве основного сосуда для работы с коррозионными реагентами при производстве лекарств высокой чистоты.	Соответствие требованиям FDA и легкость стерилизации благодаря антипригарной поверхности.
Исследования и тестирование аккумуляторов	Вымачивание материалов электродов в электролитических растворах для ускоренного старения и тестирования производительности.	Химическая совместимость с различными солями лития и органическими карбонатами.
Удаление фоторезиста в микроэлектронике	Удаление органических покрытий с подложек с использованием специализированных смесей растворителей при повышенных температурах.	Сохраняет структурную целостность при термическом напряжении и воздействии растворителей.

Параметр	Характеристика для PL-CP53
Базовый материал	100% чистый ПТФЭ высокой плотности (политетрафторэтилен)
Дополнительные материалы	PFA (перфторалкокиси) для повышенной прозрачности или химической чистоты

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Параметр	Характеристика для PL-CP53	
Размеры (Д x Ш x В)	Полностью настраиваемые (адаптированы под рабочее пространство клиента и размер партии)	
Диапазон толщины стенок	Настраиваемый (Стандарт от 5 мм до 30 мм+ в зависимости от объема)	
Рабочий диапазон температур	-200°C до +260°C (-328°F до +500°F)	
Химическая совместимость	Универсальная (За исключением расплавленных щелочных металлов и некоторых фторирующих агентов)	
Метод изготовления	Обработка на 5-осевых станках с ЧПУ / Высокоточная сварка (по требованию)	
Внутренние функции	Настраиваемые перегородки, пазы для фильтров и многоуровневые опоры	
Дренажные системы	Опционально интегрированные шаровые клапаны из ПТФЭ или порты с резьбой NPT	
Конфигурация крышки	Доступны свободно надевающиеся, на болтах или на петлях крышки из ПТФЭ	
Отделка поверхности	Обработанная гладкая (Ra < 0,8 мкм доступна по запросу)	
Нагрузочная способность	Рассчитана на поддержку конкретных плотностей материалов и объемов	